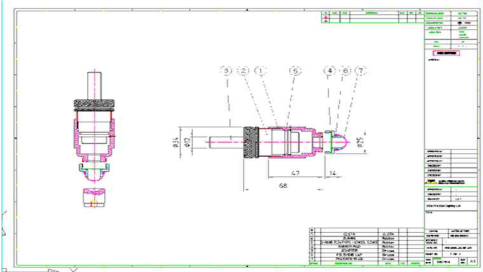
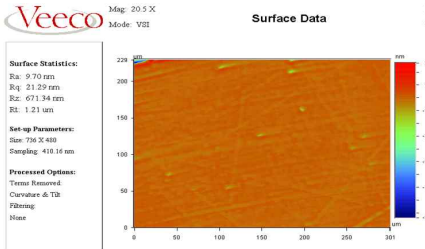
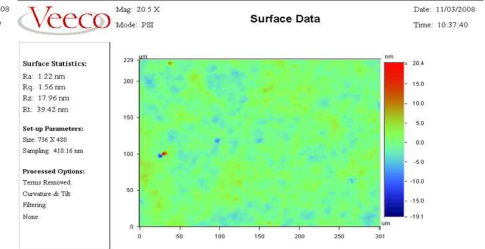


비구면 광학계 초정밀가공 공정기술

기술유형	기술이전기업	계약액	이전대상 기술
특허	(주)저스텍	120백만원 (양도금액)	비구면 광학계 초정밀가공 공정기술
기술개발 내용	○ 대면적 초정밀 미세 가공 시스템 기술에는 초정밀 미세 형상 제품을 기계적으로 가공하기 위한 초정밀 가공 장비 기술뿐만 아니라 대면적 미세 가공 공정 기술 및 가공된 금형 또는 생산된 제품의 측정·검사를 위한 기상 측정/검사 기술이 포함됨. ■ 초정밀 가공 장비는 구체적으로 5축 밀링가공 메카니즘을 기반으로 하는 문형 머시닝센터 형태의 가공기임. ■ 기존 폴리싱 장치는 단순히 폴리싱 페이퍼를 장착하여 구성한 것으로서 일정한 압력조정의 어려움으로 인한 미세연마 곤란, 렌즈가공시 정상 부분도 손상시키는 문제점 등이 있었는데, 이러한 문제점을 모두 해결한 기술임.   〈기술적용제품 Prototype〉  〈금형코어 폴리싱 전금형(Ra9.7nm)〉  〈금형코어 폴리싱 전금형 (Ra1.22nm)〉		
기술이전 내용 및 의의	○ 비구면 가공기 및 금형 가공기 등을 포함한 초정밀 가공/검사 장비의 시장규모는 2010년 약 28억달러, 2015년 약 40억 달러에 이를 것으로 예측 ■ 대면적 가공/검사 장비 및 금형 시장은 매년 약 11% 정도의 견조한 성장세를 앞으로도 당분간 유지할 것이 예상되므로, 빠른 사업화를 통해 시장 진출 도모 예정		